科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 6月 19日現在

機関番号: 82118	
研究種目: 若手研究(B)	
研究期間: 2011 ~ 2013	
課題番号: 2 3 7 4 0 2 2 1	
研究課題名(和文)超伝導空洞精密位置測定装置を用いた大電流ERLビーム不安定性の基礎研究	
研究課題名(英文)Basic research of beam instability with high current ERL beam by newly developed pos ition monitor of superconducting cavities precisely	
研究代表者	
版井 寬志 (Sakai, Hiroshi)	
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構・加速器研究施設・准教授	
研究者番号:5 0 3 4 5 2 2 9	

研究成果の概要(和文):エネルギー回収型ライナック(ERL)などの次世代型加速器では超伝導空洞がビーム性能を決めるが、ビームライン中の空洞はHe液体温度に保つため、断熱槽に覆われ、空洞の設置精度が外部から正確に測定できない。特にビームの高品質化に伴い、空洞の設置精度への要求が高まる中、極低温への冷却時の空洞変形を極低温下で常時測定することが重要な課題であった。本研究にて、極低温下での空洞変位を白色干渉の原理に基づき、非接触に±5µmの精度で常時測定する装置を新たに開発し、変位の精密測定の元、ERLテスト加速器にて、設置精度に対するビームへの影響の有無を調べ、最終的に6µAのCWビームのエネルギー回収を実現した。

研究成果の概要(英文): Alignment of superconducting cavities is one of the important issues for next gene ration accelerator like energy recovery linac (ERL). To measure the cavity displacement under cooling to liquid He temperature more precisely, we newly developed the position monitor by using white light interfer ometer. This monitor is based on the measurement of the interference of light between the measurement targ et and the reference point. It can measure the position from the outside of the cryomodule. We applied this monitor to the main linac cryomodule at ERL test facility and successfully measured the displacement during 2K cooling with the resolution of +-5um. And by monitoring these displacements in detail, we achieved the energy recovery with 6uA CW beam.

研究分野: 数物系科学

科研費の分科・細目:物理学素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理

キーワード: 加速器 ビーム物理 超伝導空洞 CWライナック 超精密測定 エネルギー回収 極低温 モニター

研究代表者は次世代放射光源であるエネ ルギー回収型ライナック(ERL)の実現に必 要不可欠な周波数 1.3GHz の 9 セル空洞の 超伝導空洞の設計開発を進めており、開発 を行っている。特に大電流(100mA 以上) ビーム実現のため、具体的には超伝導空洞 に励起する高次モード(HOM)によるビー ム不安定性を抑制する独自の空洞の設計、 製作を行い、He 液中での性能測定実験に て 25MV/m の加速勾配まで実験的に検証 し、ERL 実現への一歩を踏み出したととも に、加速器および超伝導空洞分野で世界的 に注目されることとなった。

申請時の次の課題はビーム運転用のクラ イオモジュールの設計、開発であった。超 伝導空洞をビーム運転中、常時極低温環境 を維持するため、超伝導空洞は 2K 温度の He 液体を保持した容器内に内装(ジャケ ット化)されるが、容器の温度を極低温に 保つため、ジャケット化された超伝導空洞 への常温からの入熱を防ぐための大きな断 熱槽によっておおわれている。これらを称 してクライオモジュールと呼んでいる。次 世代加速器である ERL では高品質ビーム の安定化のため、空洞のビームラインへの 設置精度は 1mm 以下とされており、その 精度を保つよう空洞をアラインメントする 必要があった。但し、超伝導空洞は室温で アラインメントされ、室温時には数 100 μ m 以下の精度でアラインメントが可能で あるが、冷却時には熱収縮の影響を受け、 空洞の位置は変化する。その変化は機器の 大きさにもより、おおよそ数 100μm~ 1cm 程度と場所によりばらばらであり、2K への冷却時への空洞の変化を随時モニター する必要がある。

申請当時に冷却中の空洞の変位測定とし て検討されていたモニターは 1)ワイヤー ポジションモニターと 2)三角測量型レー ザー変位計の2つであったが、1)に関して はワイヤーの収縮により、ワイヤーが冷却 中に切れるなどの問題が多発している。ま た測定箇所が空洞と異なり、正確な変位を 測定に疑問が残っていた。また2)に関して は、レーザー光の測定面からの乱反射の情 報を用いた三角測量を基本としたものであ る。光の受光散乱角度が大きく必要であり、 原理的に角度が 45 度に近い散乱角度にて 分解能が上がるため、輻射熱を避けるため に 500mm ほど先に小さく設けられたモジ ュール外部の狭い真空窓からの測定では 10 µ m の分解能を有する測定は不可能で あった。

これらを背景として、2010年に研究代表 者は新たに白色干渉を用いた超伝導空洞精 密位置測定装置を提案した。特に近年の周 波数安定な光コムによるモード同期レーザ ーを用い、申請時には不可能であった長距 離(1m 以上)での干渉測定により、10µm 以下の精度で長期的に空洞位置測定が可能 であることを提唱し、本研究開発の動機と なった。(図1参照。)



図1: 白色干渉による位置測定の原理

2.研究の目的

本研究の目的は超伝導空洞をモジュール 外部から入熱を抑え、非接触に空洞の位置 を直接精密測定するモニターの開発であり、 ビームへの影響を詳細に調べることにある。 特に重要なことは空洞を 2K に保つために、 モジュール外部からは非接触で、なおかつ 外部からの輻射熱の影響を最小に抑えて、 空洞の変位を測定することである。位置測 定精度は数 100 μ m の冷却中の変化などを 追随可能とするため、1 桁下の 10 μ m の分 解能を持つことが条件である。特に長期的 にも 10 μ m の精度で安定であることも位 置測定に対する要求である。具体的な研究 の目的は以下の 2 つである。

(1)白色干渉の原理に基づき 10µm の精 度の超伝導空洞非接触位置モニターの開発。 (2)超伝導空洞の変位の精密測定から、高

(2) 超広等王利の夏位の相否則たから、高 品質大電流ビームへの影響を詳細に調べる。

3.研究の方法

最終目的は位置測定装置を用いたビーム 不安定性の詳細研究であるが、その空洞位 置測定装置の開発が本研究の要となる部分 である。申請者は以下の順で研究を行う。

(1)白色干渉を用いた位置測定装置のテ ストベンチでの性能評価:

光コムによる周波数安定化実験は計測分 野を問わず近年急速に進められているが、 主に短期的な測定精度の測定を念頭におい たものである。我々の測定は加速器の運転 中を通じた非常に長い時間での測定を行う ことを念頭におく。白色周波数安定化レー ザー(光コムモードロックレーザー)また は安定な白色光源から出てくる光をファイ バーに通し、ハーフミラーにて2つに分け、 測定対象物と参照面の2つの光路から反射 された光を一つにまとめて強度の干渉を見 る。参照面側の光路をリニアガイドにて調 整し、強度のピークをモニターし、本モニ ターの位置測定精度の測定を行う。具体的 な性能評価試験としては、 位置測定精度 の評価を行い、特に測定対象面の傾きの誤 差評価などを行う。 測定対象物の材質、 表面精度の変化によるモニター性能評価測 定を行い、最後に 長距離での長期安定化 の測定にて安定化の評価を行い、10µm程 度の安定化測定を行えるかの成否を問い、 実機設計に反映する。

(2)ERL 超伝導空洞のクライオモジュール の設計、実機位置測定装置の設計:

位置測定装置の評価と平行して、ERL 用 の超伝導空洞のクライオモジュールの詳細 設計を進める。特に空洞を支える機械設計、 熱設計、磁気シールド設計がメインとなる が、それら設計と干渉しないよう位置測定 装置の配置を行う。具体的に空洞側面の水 平方向、及び垂直方向の位置をモニターす るよう設計を行うが、測定場所の妥当性、 ビームに対する評価を行うための設計、手 法などの検討を行う。

(3) 実機クライオモジュールでの白色干 渉位置測定装置の実証実験:

テストベンチでの評価をもとに具体的な 配置が決まり、実機の位置測定モニターの モジュールを用いた位置測定を行う。特に モジュールの 2K He 温度冷却中の変位を 追っていく。この変位が正しいかどうかは 他モニターとの相関を取り評価する。

(4) 位置測定装置を用いたビーム実験による ERL のビーム不安定性の詳細研究:

位置測定装置の実機での一通りでの性能 評価が終わった時点でビーム実験の開始と なる。ERL 試験加速器であるコンパクト ERL 加速器内に超伝導空洞を設置後、ビー ムを用いて、空洞の位置に対するビーム不 安定性の評価及び不安定性が大きい場合な どは空洞位置を変位させ、ビームに対する 応答から何によるビーム不安定性なのか詳 細な解析を行う。

これらはすべて当時建設中である ERL の試験加速器(Compact ERL)で行われる。

4.研究成果

ここまで行ってきた研究成果を以下にま とめる。

(1)白色干渉を用いた位置測定装置のテストベンチでの性能評価:

テストベンチにて、白色干渉を用いた非 接触計測による位置測定精度評価試験を行 った。図2がそのsetupである。



図 2: テストベンチでの setup。

光カプラーにて分岐した測定対象物と参 照ターゲットからの白色レーザーの反射光 の干渉強度を参照ターゲットの距離の関数 として、随時モニターすることで、性能評 価を行う。まず既存の半導体レーザー光で あるSLD白色光源(20mW)を用い評価を行 った結果、測定精度には現状、スペクトラ ムの形よりも強度が重要であるとの結論を 得たため、研究代表者は光コム光源より安 価の白色光源で強度が既存の5倍以上を確 保できるASE光源を購入した。この高強度 白色光源を用いて、まずはテントベンチに て、測定対象物の表面粗さと測定可能な傾 きを調べた。

表1: 各測定対象物の表面粗さに対する 測定可能な干渉強度の範囲

表面粗さ(Ra)	測定可能な角度
20.95 μm	0度~30度
4.38 μm	0 度~30 度
0.23 μm	0度~20度

表1が測定可能な干渉強度が得られた範 囲である。粗さが0.23~20μmの広範囲で なおかつ測定対象が垂直から20度ずれた場 合でも十分な干渉強度が得られることがテ ストベンチの結果から分かった。この結果 を反映し、1000mm離れた表面粗さRa4.4 μmの測定対象物に対し、長期間での測定 精度の測定を行った。

図3が測定器の温度、湿度、気圧の変化 に対する測定位置の長期安定性の結果であ る。12時間の測定で、温度変化が±0.3度の 環境下にて、±5µm以下で安定であった。 特にレーザー光は 30mmのパイプとガラ スのviewportを通じて行った断熱槽外部か らの測定を模擬しており、測定精度、長期 安定性に対し、位置モニターとして、十分 な性能が確保できた。



図 3: テストベンチでの長期安定性測定 (2)ERL超伝導空洞のクライオモジュー

ルの設計、実機位置測定装置の設計: テストベンチでの性能評価と平行に、ク ライオモジュールの設計を進め、熱シール ドなどとの干渉なしで、本レーザー位置モ ニターで測定するターゲットの場所と設計 を進めた。



図4:Compact ERL 用主加速部超伝導空洞 クライオモジュールとターゲットの配置。

図4 がCompactERLの主加速部用に設計 した9セル空洞を2つ収める超伝導空洞ク ライオモジュールである。空洞は2Kに冷や されるがそれらのアラインメントなどを確 保しやすくするために5Kフレームと呼ば れる空洞固定用のサポートを空洞回りに設 置。またそれらはクライオモジュール内の 5Kフレーム下部の常温部に置かれたバッ クボーンと呼ばれる堅牢なサポートによっ て、支えられている構造とした。特にバッ クボーンから5Kフレームに対しての支え (5Kサポート)は合計8か所で支えており、 室温から2Kへの冷却の際、5Kフレームの位 置が極力変化しないような熱収縮をキャン セルする構造としている。5Kフレームおよ び、5Kサポートを通じ、空洞への熱侵入を 防ぐとともにアラインメントを確保する設 計とした。特に収縮時の空洞変位のための

ターゲットは5Kフレームの上部とサイド に合計8つ、空洞の前後に置くことで、空 洞の冷却中の変化を追えるような設計を進 めた。特にターゲットの中心を目盛を刻ん だガラスを用意し、望遠鏡でその中心を読 める構造とした。ターゲットの側面(表面粗 さRa 1.6 µm)を白色干渉モニターにて、位 置測定することで、冷却中の変位を干渉計 と望遠鏡(測定精度は0.1mm程度)の両方 で測定可能な設計とした。

(3) 実機クライオモジュールでの白色干 渉位置測定装置の実証実験:



図5: Compact ERL 内に設置された主加 速部超伝導空洞クライオモジュール。

テストベンチでの評価を基にして、実機 の白色干渉位置変位計を製作し、製作した ERL用クライオモジュール(図5)を用いた 2K冷却中の位置測定を行った。まず、最初 は空洞の一か所(図4のターゲット#1)のみ の垂直、水平の2方向の測定に絞り、実機 位置測定装置として製作した。また、ター ゲットの中心をLEDで照らし、冷却中の動 きに対する光学ターゲットとの相関データ を取得した。



図 6: クライオモジュール内ターゲットと 実機白色干渉位置測定装置の配置。

2012年秋までにCompact ERL主加速部 超伝導空洞クライオモジュールを完成し、 2012年11月から本格的な冷却を行った。ク ライオモジュールの2Kまでの冷却中の測 定の詳細を述べる。図6に示すように測定 光学ターゲットはセンサーのファイバー出 口から600mm離れた断熱真空槽内に置か れ、ビューポートを通して水平方向、垂直 方向の変位を冷却中常時測定した。特に加 速器室内での温度変化抑制のため、温度安 定化ファイバーを用いて測定を行った。室 温から2Kまでの冷却は2週間かけてゆっ くり行われ、図7が冷却中の実機白色干渉 位置測定装置によるクライオモジュール内 のターゲット(#1)の測定位置変位である。 常温から2K冷却後の温度変化はモジュー ル熱設計通りに、水平方向で0.2mm、垂直 方向で1.2mmの変位が測定され、空洞中心 では0.4mmの変化に留まっていることが測 定から判明した。



図7:(左図)モジュール内ターゲットの冷 却時の水平方向(青)と垂直方向(赤)の 変化。赤丸、青丸はターゲットを望遠鏡で 覗いた結果であり、赤線、青線が白色干渉 位置測定装置による測定結果である。緑線 は空洞温度を示す。(右図) 左図一部拡大図

図7から得られた本変位計にて達成された結果は、以下である。1)望遠鏡の精度の±0.1mm程度で光学ターゲットとの相関が得られたこと、2)特に望遠鏡の精度では見られなかった冷却中の空洞温度との詳細な相関が得られたこと、3)2K到達温度での安定な状態では水平、垂直方向とも変位計の測定値が±10µmの精度で12時間安定であったことである。

本変位計が冷却下のクライオモジュール 内の空洞の変位を±10µmの精度で精密に 測定可能であることを実証した。

(4) 位置測定装置を用いたビーム実験に よる ERL のビーム不安定性の詳細研究: 実機変位計にて、2012年11月からのクラ

イオモジュール冷却時の空洞変位はファイ バーの温度変動の影響を抑えるため、ファ イバー長を3mと短く抑え、温度が±0.5 以下に安定な本超伝導空洞モジュールが設 置されている加速器室内環境下に測定系を 置き、冷却中の変位測定の実証実験を行っ たが、その後の2012年12月の空洞加速勾配 実現のためのハイパワー試験時には放射線 の影響が大きく、加速器内部に設置してい た本測定装置を一旦加速器室から出したた め、パワー試験時の位置測定は不可能であ った。2013年冬に控えたビーム運転時の測 定を可能とするために、以下の改良を行っ た。(a)光路差の温度変動を無くすために、 測定対象用ファイバー光路内に参照面を同 時に設けた。結果、80mのファイバー長に て、25±5 の温度環境下、40時間以上で ±3µm以下の超高安定位置測定を実現し た。(b) 空洞1か所の水平、垂直方向(2軸))の測定から空洞前後の2か所の垂直、水 平方向(4軸)に測定点(図4のターゲット #1)を増やし、ビームに対し、2K冷却中 のモジュールの位置と角度両情報の測定を 可能とした。



図8:(左図)改良白色干渉位置測定装置 による2013年11月から約半年間のターゲ ット(#1)の水平方向の測定結果(赤、 青)(右図)垂直方向の測定結果(桃、黒)。 水色、緑は空洞温度。

上記(a).(b)の改良後、PC など測定機器は 加速器室外で制御可能となり、2K 冷却後 のビーム運転が始まってから2か月の長期 に渡り、ビーム運転中の空洞変位を詳細に モニターすることが可能であった。図8は Compact ERL の再冷却およびビーム運転 が開始した 2013 年 11 月~2014 年 4 月頭 まで2回の冷却サイクル過程を経た長期運 転時の改良後白色干渉位置測定装置の測定 結果である。2K 冷却後は水平方向 0.2-0.3mm、垂直方向では 1.2-1.3mm と 2012年の変位をほぼ再現した。運転中も放 射線の影響なく、長期的にビーム運転時の 2K 冷却時では±5µm で空洞の安定性を 確認する(図9参照)と同時に、ビームに 対しても、空洞が要求値である 1mm 以内 に設置されていることを確認した。



図 9: ビーム運転時の空洞位置測定結果。 (2日間)

さらに、他ビームモニターと合わせ、デー タベース化され、空洞位置の詳細測定のも と、ビーム調整がスムーズに行われ、空洞 位置によるビーム不安定性も見られず、最 終的に、図10に示すように国内初の6µ A以上のCWビームで20MeVのエネルギ ー回収運転を実現した。

(5)まとめ

本研究課題は新しい白色干渉の原理のも と、空洞変位を精密(10µm以内)に測定す る装置を開発するとともにモジュール内の 空洞の変位情報から、ERLに対するビーム 不安定性に対する知見を得ることを目指し たものである。まず、テストベンチ、実機、

そしてビーム運転時と段階的な試験を踏ま え、白色干渉の原理のもと空洞モジュール の4か所を±5µmの精度にて約半年の長 期間測定を行える位置測定装置を開発した。 これは今後の4空洞また8空洞入りの ERL 空洞モジュールの製作にとどまらず 将来のリニアコライダ、また X 線自由電子 レーザーなどの超伝導空洞を用いた先端加 速器の精密アラインメントや位置測定に非 常に大きく貢献するものである。また、現 装置を用いて空洞がアライメントの範囲内 におさまり、6µA 以上の CW ビームで空 洞起因の不安定性もなくエネルギー回収を 実現したことで、モジュール製作に対する 指標が確立しただけでなく、今後の大電流 ERL運転に向けて大きな指標を示すこと ができたことが本研究の大きな収穫である。



図10:6.5µAのCWビームによるエネルギ ー回収実験結果。本来CWビーム加速に使わ れるエネルギー負荷が回収ビームを主空洞 に減速位相でいれることで、減速ビームから エネルギーが供給され、エネルギー回収が達 成されている。

5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者 には下線)

〔雑誌論文〕(計20件)

<u>H. Sakai</u>, T. Aoto, K. Enami, T. Furuya, M. Sato, K. Shinoe, K. Umemori, E. Cenni, M. Sawamura, K. Hayashi, T. Kanzaki, "Precise Measurement of Superconducting Cavity Movement in Cryomodule by the Position Monitor Using White Light Interferometer", Proc. of SRF2013, (Paris, France) p288-293, (2013). (查読無)

E. Cenni, T. Furuya, <u>H. Sakai</u>, K. Umemori, K. Enami, K. Shinoe, M. Sato, M. Sawamura, "Field Emission Measure During cERL Main Linac Cryomodule High Power Test in KEK", Proc. of SRF2013, (Paris, France) p672-676, (2013) (査読無)

K. Umemori, K. Enami, T. Furuya, <u>H. Sakai</u>, M. Sato, K. Shinoe, M. Sawamura, E. Cenni, "Construction of Main Linac Cryomodule for Compact ERL Project", Proc. of IPAC2013, (Shanghai, China) p2349-2351, (2013) (査読 無)

K. Umemori, K. Enami, T. Furuya, <u>H. Sakai</u>, M. Sato, K. Shinoe, M. Sawamura, E. Cenni, "Status of Main Linac Cryomodule for Compact ERL Project", Proc. of IPAC2012, (New Orleans, U.S.A), p67-69, 2012 (査読無)

H. Sakai, T. Furuya, N. Nakamura, K. Umemori, K. Shinoe, M. Sawamura, E. Cenni, "High Power Tests of KEK-ERL Input Coupler for Main Linac under Liquid Nitrogen Condition", Proc. of SRF2011, (Chicago, U.S.A), p356-360, (2011) (査読無)

[学会発表](計23件)

第27回日本放射光学会年会。

<u>阪井寛志</u>, 他 86 人,「Compact ERL 周回部 の現状 –高品質、大電荷ビームエネルギー 回収実現に向けて --」,広島,広島,1月12 日,(2014).

SRF2013, 招待講演

H. Sakai, K. Enami, T. Furuya, M. Sato, K. Shinoe, K. Umemori,

E. Cenni, M. Sawamura, "High Power CW Tests of cERL Main-Linac Cryomodule", THIOC02, SRF2013, (Paris, France) September 26, (2013).

第10回日本加速器学会年会

<u>阪井寛志、</u>梅森健成、江並和宏、佐藤昌史、

沢村勝、篠江憲治、古屋貴章、Cenni Enrico, 「Comapet ERL 主加速部超伝導空洞クライ オモジュールのハイパワーテスト」,

MOOT09, 名古屋, 愛知, 8月5日, (2013). SRF2011, 招待講演

<u>H. Sakai</u>, "Overview of CW Input Coupler for ERL", FRIOA05, SRF2011, (Chicago, U.S.A) July 29, (2011).

SRF2011, 招待講演

K. Umemori, T. Furuya, E. Kako, S. Noguchi, H. Sakai, M. Sato, T. Shishido,

K. Watanabe, Y. Yamamoto, K. Shinoe, M. Sawamura, E. Cenni, "Construction of Main Linac Cryomodule for Compact ERL Project", FRIOA06, SRF2011, (Chicago, U.S.A) July 29, (2011).

〔その他〕 ホームページ等 http://pfwww.kek.jp/ERLoffice/

6.研究組織

(1)研究代表者
阪井 寛志 (SAKAI HIROSHI)
高エネルギー加速器研究機構・加速器研究施設・准教授
研究者番号:50345229